

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 9月 8日

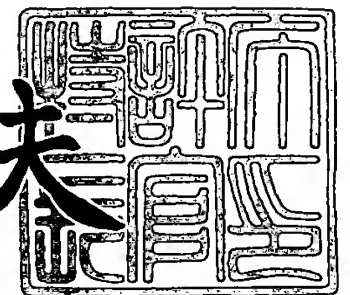
出願番号
Application Number: 特願2003-315831
[ST. 10/C]: [JP 2003-315831]

出願人
Applicant(s): 株式会社デンソー

2003年10月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 N-83430
【提出日】 平成15年 9月 8日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 B01J 35/04
【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内
 【氏名】 石原 幹男
【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内
 【氏名】 西村 養
【特許出願人】
 【識別番号】 000004260
 【氏名又は名称】 株式会社デンソー
【代理人】
 【識別番号】 100079142
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高橋 祥泰
【選任した代理人】
 【識別番号】 100110700
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 岩倉 民芳
【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2002-300828
 【出願日】 平成14年10月15日
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 009276
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0105519

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを備えたセラミックハニカム構造体を有する排ガス浄化フィルタにおいて、

上記セラミックハニカム構造体の両端面は、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設けたとき、該仮想線よりも外側の外周領域を 9 0 % 以上栓材によって閉塞してなることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 2】

請求項 1 において、上記仮想線が通る各セルの開口部は、その一部又は全部を上記栓材によって閉塞されていることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 において、上記セラミックハニカム構造体は、上記外周壁及び隔壁の気孔率が 5 0 % 以上であることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれか一項において、上記外周壁は、0. 2 ～ 0. 8 mm の厚みを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 5】

請求項 1 ～ 4 のいずれか一項において、上記セラミックハニカム構造体は、コージエライトからなることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれか一項において、上記排ガス浄化フィルタは、ディーゼルエンジンから排出される排ガスの浄化を行うディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタであって、上記セラミックハニカム構造体の端面における上記仮想線よりも内側の中央領域は、栓材を設けたセルの開口部と、栓材を設けないセルの開口部とが互いに隣り合うようにして混在していることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 7】

請求項 1 ～ 6 のいずれか一項において、上記仮想線は、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 2. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた線であることを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 8】

請求項 1 ～ 7 のいずれか一項において、上記隔壁は、0. 2 5 ～ 0. 4 0 mm の厚みを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタ。

【請求項 9】

外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスキング工程と、

上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、少なくとも該仮想線が通るセル及び該仮想線よりも外側のセルの開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施す穴明け工程と、

その後、栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、9 0 % 以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 0】

請求項 9 において、上記穴明け工程においては、上記仮想線よりも内側の上記セルの開口部に貼付された上記マスクテープについては、互いに隣り合う上記セルの開口部のうちいずれか一方の開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施すことを特徴とする排ガス

浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 1】

外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面に、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線よりも内側の中央領域にマスクテープを貼付するマスキング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 2】

請求項 1 1 において、上記マスキング工程の後、上記栓詰め工程の前には、少なくとも上記仮想線が通るセルの開口部を被うマスクテープに穴明けを施す穴明け工程を行うことを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 3】

外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスキング工程と、

上記端面に、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線よりも外側の外周領域に貼付されたマスクテープを切除するカッティング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 4】

請求項 1 3 において、上記カッティング工程の後、上記栓詰め工程の前には、少なくとも上記仮想線が通るセルの開口部を被うマスクテープに穴明けを施す穴明け工程を行うことを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 5】

外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスキング工程と、

上記端面に、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線が通るセルの隔壁に沿ってマスクテープを切断すると共に、その外側のマスクテープを除去するカッティング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 6】

請求項 1 1 ～ 1 5 のいずれか一項において、上記マスキング工程の後、上記栓詰め工程の前に、上記仮想線よりも内側の上記セルの開口部に貼付された上記マスクテープについては、互いに隣り合う上記セルの開口部のうちいずれか一方の開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施すことを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 7】

請求項 9 ～ 1 6 のいずれか一項において、上記仮想線は、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 2. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた線であることを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【請求項 1 8】

請求項 9 ～ 1 7 のいずれか一項において、上記隔壁は、0. 2 5 ～ 0. 4 0 mm の厚みを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 排ガス浄化フィルタ及びその製造方法

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、内燃機関から排出される排ガス中のパーティキュレートを捕集して排ガスの浄化を行う排ガス浄化フィルタ及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

従来より、内燃機関から排出される排ガス中のパーティキュレートを捕集して排ガスの浄化を行う排ガス浄化フィルタとして、セラミックハニカム構造体を有する排ガス浄化フィルタがある。

上記セラミックハニカム構造体は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有する。

【0 0 0 3】

上記排ガス浄化フィルタの浄化効率を高めるべく、上記隔壁はより薄くかつ気孔率を高くすることが望まれる。ところが、隔壁を薄く、気孔率を高くすると、上記セラミックハニカム構造体の機械的強度が低下する。そのため、触媒を付与する際や内燃機関に取り付ける際などに、上記セラミックハニカム構造体の端部に欠けが生じ易くなるという問題がある。

これに対し、外周部付近のセルに、栓材を充填したセラミックハニカム構造体が提案されている（例えば、特許文献 1，2 参照）。

【0 0 0 4】

しかしながら、上記従来のセラミックハニカム構造体においては、上記栓材を充填する外周領域の範囲について何ら規定されていない。上記栓材を充填する外周領域の範囲が大きすぎると、排ガスの濾過面積が小さくなると共に圧力損失が増大するという問題がある。一方、上記栓材を充填する上記外周領域が小さすぎると、セラミックハニカム構造体の強度を確保することができない。

それ故、単に外周部付近に栓材を充填しただけでは、強度が高く、かつ浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることは困難である。

【0 0 0 5】

【特許文献 1】 特公昭 6 3 - 1 2 6 5 8 号公報

【特許文献 2】 特開平 7 - 2 4 6 3 4 1 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 6】

本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタ及びその製造方法を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 7】

第 1 の発明は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを備えたセラミックハニカム構造体を有する排ガス浄化フィルタにおいて、

上記セラミックハニカム構造体の両端面は、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設けたとき、該仮想線よりも外側の外周領域を 9 0 % 以上栓材によって閉塞してなることを特徴とする排ガス浄化フィルタにある（請求項 1）。

【0 0 0 8】

次に、本発明の作用効果につき説明する。

上記セラミックハニカム構造体は、上述のごとく、両端面における上記外周領域を 9 0

%以上栓材によって閉塞してなる。

そのため、上記セラミックハニカム構造体の両端面の外周部が補強される。そして、上記仮想線が、上記外周壁の内側面からセル 1 ピッチの 1. 0 倍以上の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げたものであるため、上記栓材を詰める上記外周領域の幅がセル 1 ピッチの 1. 0 倍以上となる。それ故、上記セラミックハニカム構造体の強度を十分に確保することができる。これにより、上記排ガス浄化フィルタの製造時、取り扱い時等における欠けの発生を防止することができる。

【0 0 0 9】

また、上記仮想線が、上記外周壁の内側面からセル 1 ピッチの 3. 0 倍以下の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げたものであるため、上記栓材を詰める上記外周領域の幅がセル 1 ピッチの 3. 0 倍以下となる。それ故、排ガス浄化フィルタにおいて、排ガスを通すことができない上記外周領域の面積を十分に小さくすることができる。これにより、排ガスの濾過面積を確保することができると共に、排ガスの圧力損失を抑制することができる。そのため、浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 1 0】

以上のごとく、本発明によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 1 1】

第 2 の発明は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスキング工程と、
上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、少なくとも該仮想線が通るセル及び該仮想線よりも外側のセルの開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施す穴明け工程と、

その後、栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法にある（請求項 9）。

【0 0 1 2】

本製造方法によれば、上記セラミックハニカム構造体における上記外周領域に、栓材を容易かつ確実に形成することができる。

従って、上記第 2 の発明によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを容易かつ確実に製造することができる。

【0 0 1 3】

第 3 の発明は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面に、上記外周壁の内側面から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線よりも内側の中央領域にマスクテープを貼付するマスキング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法にある（請求項 11）。

【0 0 1 4】

本製造方法によれば、上記外周領域にはマスクテープを貼付しないため、該マスクテープに穴明けを行うことなく、外周領域に栓材を形成することができる。そのため、工数を削減することができ、排ガス浄化フィルタを容易に製造することができると共に、製造コストを削減することができる。

【0 0 1 5】

第4の発明は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスクング工程と、

上記端面に、上記外周壁の内側面から上記セル1ピッチの1.0～3.0倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線よりも外側の外周領域に貼付されたマスクテープを切除するカッティング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法にある（請求項13）。

【0 0 1 6】

本製造方法によれば、上記セラミックハニカム構造体の端面にマスクテープを貼付する際、厳密な位置合せをする必要がないため、貼付作業が容易である。それ故、上記第4の発明によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを容易に製造することができる。

【0 0 1 7】

第5の発明は、外周壁と、該外周壁の内側においてハニカム状に設けられた隔壁と、該隔壁により仕切られていると共に両端面に貫通してなる複数のセルとを有するセラミックハニカム構造体を成形する成形工程と、

該セラミックハニカム構造体の端面全体にマスクテープを貼付するマスクング工程と、

上記端面に、上記外周壁の内側面から上記セル1ピッチの1.0～3.0倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線を設け、該仮想線が通るセルの隔壁に沿ってマスクテープを切断すると共に、その外側のマスクテープを除去するカッティング工程と、

栓材ペーストに上記端面をディッピングして、上記マスクテープにより閉塞されているセル以外のセルの開口部に栓材を形成して、上記仮想線よりも外側の外周領域を、90%以上栓材によって閉塞する栓詰め工程とを有することを特徴とする排ガス浄化フィルタの製造方法にある（請求項15）。

【0 0 1 8】

本製造方法によれば、上記仮想線が通るセルを被うマスクテープをも除去して、該セルの開口部の全体を開放することができる。そのため、上記仮想線が通るセルには、その開口部の全体に上記栓材を形成することができる。

また、上記仮想線が通るセルの開口部には、改めて穴明けを行う必要がない。

従って、第5の発明によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを容易に製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 1 9】

上記第1の発明（請求項1）において、上記セル1ピッチとは、下記の定義式（1）により定義される。

$$1 \text{ ピッチ} = 25.4 / (\text{メッシュ数})^{1/2} \dots (1)$$

ここで、メッシュ数とは、25.4 mm四方中に存在するセルの数をいう。

従って、上記セルが断面正形状であれば、1ピッチとはセルの1辺の長さに隔壁の厚みを足した長さとなる。

また、上記栓材により閉塞する上記外周領域の90%とは、上記外周領域にあるセルの開口部の総面積を基準としたものである。

【0 0 2 0】

また、上記仮想線が通る各セルの開口部は、その一部又は全部を上記栓材によって閉塞することができる（請求項2）。

上記セルの開口部の一部を栓材によって閉塞する場合には、製造が容易である。また、

上記セルの開口部の全部を栓材によって閉塞する場合には、より強度に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 2 1】

また、上記セラミックハニカム構造体は、上記外周壁及び隔壁の気孔率が50%以上とすることができる（請求項3）。

この場合には、排ガスの濾過面積、触媒担持面積が大きくなり、浄化効率の高い排ガス浄化フィルタを得ることができる。

また、この場合には、仮に上記外周領域に栓材を設けないと、上記セラミックハニカム構造体の強度が低く、欠けが生じやすい。そこで、上述のごとく外周領域に栓材を形成することにより、セラミックハニカム構造体の強度を向上させ、ひいては排ガス浄化フィルタの強度を向上させることができる。

上記気孔率が50%未満の場合には、排ガス浄化効率を十分に向上させることが困難となるおそれがある。

【0 0 2 2】

また、上記外周壁は、0.2～0.8mmの厚みを有することが好ましい（請求項4）。

この場合には、排ガス浄化フィルタの強度と排ガス浄化効率とを確保することができる。

上記厚みが0.2mm未満の場合には、排ガス浄化フィルタの強度を確保することが困難となるおそれがある。一方、上記厚みが0.8mmを超える場合には、排ガスの濾過面積が小さくなると共に、圧力損失が大きくなり、排ガス浄化効率を充分確保することが困難となるおそれがある。

【0 0 2 3】

また、上記セラミックハニカム構造体は、コージェライトからなることが好ましい（請求項5）。

この場合には、所望の気孔率の外周壁及び隔壁を有するセラミックハニカム構造体を容易かつ安価に成形することができる。

【0 0 2 4】

また、上記排ガス浄化フィルタは、ディーゼルエンジンから排出される排ガスの浄化を行うディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタであって、上記セラミックハニカム構造体の端面における上記仮想線よりも内側の中央領域は、栓材を設けたセルの開口部と、栓材を設けないセルの開口部とが互いに隣り合うようにして混在しているものであってもよい（請求項6）。

この場合には、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れたディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタを提供することができる。

【0 0 2 5】

また、上記仮想線は、上記外周壁の内側面から上記セル1ピッチの1.0～2.0倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた線であることが好ましい（請求項7）。

この場合には、上記セラミックハニカム構造体の強度を十分に確保しつつ、浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる（実施例7参照）。

【0 0 2 6】

また、上記隔壁は、0.25～0.40mmの厚みを有することが好ましい（請求項8）。

この場合には、排ガス中のパーティキュレートを十分に捕集できると共に、排ガスの圧力損失を抑制することができる。それ故、より浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる。

上記隔壁の厚みが0.25mm未満の場合には、上記パーティキュレートが上記隔壁をすり抜けやすくなり、パーティキュレートの捕集率が低下するおそれがある。一方、上記隔壁の厚みが0.40mmを超える場合には、上記排ガスの圧力損失が高くなるおそれがある（実施例8参照）。

【0 0 2 7】

次に、上記第 2 の発明（請求項 9）において、上記マスキング工程、穴明け工程、及び栓詰め工程は、上記セラミックハニカム構造体の両方の端面に対してそれぞれ行うことができる。

【0 0 2 8】

また、上記穴明け工程においては、上記仮想線よりも内側の上記セルの開口部に貼付された上記マスクテープについては、互いに隣り合う上記セルの開口部のうちいずれか一方の開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施すことができる（請求項 1 0）。

この場合には、上記セラミックハニカム構造体の端面における上記仮想線よりも内側の中央領域は、栓材を設けたセルの開口部と、栓材を設けないセルの開口部とが互いに隣り合うようにして混在することとなる。その結果、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れたディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 2 9】

次に、上記第 3 の発明（請求項 1 1）において、上記マスキング工程の後、上記栓詰め工程の前には、少なくとも上記仮想線が通るセルの開口部を被うマスクテープに穴明けを施す穴明け工程を行うことが好ましい（請求項 1 2）。

この場合には、上記仮想線が通るセルの開口部にも、その全部に栓材を形成することができる。そのため、一層強度の高い排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 3 0】

また、上記第 4 の発明（請求項 1 3）において、上記カッティング工程の後、上記栓詰め工程の前には、少なくとも上記仮想線が通るセルの開口部を被うマスクテープに穴明けを施す穴明け工程を行うことが好ましい（請求項 1 4）。

この場合には、上記仮想線が通るセルの開口部にも、その全部に栓材を形成することができる。そのため、一層強度の高い排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 3 1】

また、上記第 3 の発明（請求項 1 1）又は第 4 の発明（請求項 1 3）において、上記マスキング工程の後、上記栓詰め工程の前に、上記仮想線よりも内側の上記セルの開口部に貼付された上記マスクテープについては、互いに隣り合う上記セルの開口部のうちいずれか一方の開口部に貼付されたマスクテープに穴明けを施すことができる（請求項 1 6）。

この場合には、上記セラミックハニカム構造体の端面における上記仮想線よりも内側の中央領域は、栓材を設けたセルの開口部と、栓材を設けないセルの開口部とが互いに隣り合うようにして混在することとなる。その結果、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れたディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【実施例】

【0 0 3 2】

（実施例 1）

本発明にかかる排ガス浄化フィルタ及びその製造方法につき、図 1 ～図 1 1 を用いて説明する。

図 1 ～図 3 に示すごとく、上記排ガス浄化フィルタ 1 は、外周壁 2 1 と、該外周壁 2 1 の内側においてハニカム状に設けられた隔壁 2 2 と、該隔壁 2 2 により仕切られていると共に両端面 2 4 1、2 4 2 に貫通してなる複数のセル 2 3 とを備えたセラミックハニカム構造体 2 を有する。

【0 0 3 3】

上記セラミックハニカム構造体 2 の両端面 2 4 1、2 4 2 は、図 1 に示すごとく、上記外周壁 2 1 の内側面 2 1 1 から上記セル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線 3 を設けたとき、該仮想線 3 よりも外側の外周領域 2 5 を 9 0 % 以上栓材 4 によって閉塞してなる。

【0 0 3 4】

上記セル 1 ピッチとは、上述した定義式（1）により定義されるが、本例においては、図 4 に示すごとく、上記セル 2 3 が断面正形状であるため、1 ピッチとはセル 2 3 の 1

辺の長さ a に隔壁 2 2 の厚み b を足した長さとなる。

具体的には、上記セル 2 3 の一辺の長さ a は、1. 0 7 ~ 1. 2 7 mm であり、隔壁 2 2 の厚み b は 0. 2 5 ~ 0. 3 5 mm である。それ故、1 ピッチは、1. 3 2 ~ 1. 6 2 mm である。

また、上記外周壁 2 1 は、0. 2 ~ 0. 8 mm の厚みを有する。また、上記栓材 4 は、上記端面 2 4 1, 2 4 2 から 1 ~ 6 mm の深さ分上記セル 2 3 の開口部 2 3 1 に配設されている。

【0 0 3 5】

また、上記セラミックハニカム構造体 2 は、上記外周壁 2 1 及び隔壁 2 2 の気孔率が 5 0 % 以上である。

また、上記セラミックハニカム構造体 2 は、コージェライトからなる。また、栓材 4 もコージェライトからなる。

【0 0 3 6】

また、上記排ガス浄化フィルタ 1 は、ディーゼルエンジンから排出される排ガスの浄化を行うディーゼルエンジン用排ガス浄化フィルタである。そして、図 1, 図 3 に示すごとく、上記セラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1, 2 4 2 における上記仮想線 3 よりも内側の中央領域 2 6 は、栓材 4 を設けたセル 2 3 の開口部 2 3 1 と、栓材 4 を設けないセル 2 3 の開口部 2 3 1 とが互いに隣り合うようにして混在している。

即ち、図 3 に示すごとく、上記中央領域 2 6 におけるセル 2 3 は、そのいずれか一方の開口部 2 3 1 が上記栓材 4 によって閉塞されており、隣り合うセル 2 3 は、互いに反対側の開口部 2 3 1 に栓材 4 を形成してなる。

【0 0 3 7】

次に、本例の排ガス浄化フィルタ 1 の製造方法につき説明する。

まず、外周壁 2 1 と、隔壁 2 2 と、複数のセル 2 3 とを有するセラミックハニカム構造体 2 を成形する成形工程を行う。

次いで、図 5 に示すごとく、該セラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1 全体にマスクテープ 5 を貼付するマスキング工程を行う。

【0 0 3 8】

その後、図 7 に示すごとく、上記仮想線 3 (図 1) が通るセル 2 3 及び該仮想線 3 よりも外側のセル 2 3 の開口部に貼付されたマスクテープ 5 に穴明けを施す。このとき、中央領域 2 6 におけるセル 2 3 の開口部 2 3 1 にも市松模様状にマスクテープ 5 に穴明けを施す穴明け工程を行う。

その後、図 8 に示すごとく、栓材ペースト 4 1 に上記端面 2 4 1 をディッピングして、図 9 に示すごとく、上記マスクテープ 5 により閉塞されているセル以外のセル 2 3 の開口部 2 3 1 に栓材 4 を形成する栓詰め工程を行う。

【0 0 3 9】

また、図 1 0, 図 1 1 に示すごとく、上記セラミックハニカム構造体 2 における他の端面 2 4 2 にも同様に、栓材 4 を形成する。

これにより、図 1 に示すごとく、上記セラミックハニカム構造体 2 の両端面 2 4 1, 2 4 2 における上記仮想線 3 よりも外側の外周領域 2 5 を、9 0 % 以上栓材 4 によって閉塞する。

【0 0 4 0】

また、上記穴明けは、図 6 に示すごとく、まずカメラ 5 1 によってセラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1 (2 4 2) を撮像し、画像処理することにより、穴明けすべき位置の検出を行う。次いで、図 7 に示すごとく、レーザ 5 2 によりマスクテープ 5 に穴明けを行う。

【0 0 4 1】

上記のごとく、所定のセル 2 3 の開口部 2 3 1 に栓材 4 を形成した後、セラミックハニカム構造体 2 を焼成して、排ガス浄化フィルタ 1 を得る。

また、上記排ガス浄化フィルタ 1 における隔壁 2 3 には、触媒を担持させることができ

る。

【0 0 4 2】

次に、本例の作用効果につき説明する。

上記セラミックハニカム構造体 2 は、上述のごとく、両端面 2 4 1、2 4 2 における上記外周領域 2 5 を 9 0 % 以上栓材 4 によって閉塞してなる。

そのため、上記セラミックハニカム構造体 2 の両端面 2 4 1、2 4 2 の外周部、即ち角部が補強される。そして、上記仮想線 3 が、上記外周壁 2 1 の内側面 2 1 1 からセル 1 ピッチの 1. 0 倍以上の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げたものであるため、上記栓材 4 を詰める上記外周領域 2 5 の幅がセル 1 ピッチの 1. 0 倍以上となる。それ故、上記セラミックハニカム構造体 2 の強度を十分に確保することができる。これにより、上記排ガス浄化フィルタ 1 の製造時、取り扱い時等における欠けの発生を防止することができる。

【0 0 4 3】

また、上記仮想線 3 が、上記外周壁 2 1 の内側面 2 1 1 からセル 1 ピッチの 3. 0 倍以下の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げたものであるため、上記栓材 4 を詰める上記外周領域 2 5 の幅がセル 1 ピッチの 3. 0 倍以下となる。それ故、排ガス浄化フィルタ 1 において、排ガスを通すことができない上記外周領域 2 5 の面積を十分に小さくすることができる。これにより、排ガスの濾過面積を確保できると共に、排ガスの圧力損失を抑制することができる。そのため、浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタ 1 を得ることができる。

【0 0 4 4】

また、上記セラミックハニカム構造体 2 は、上記外周壁 2 1 及び隔壁 2 2 の気孔率が 5 0 % 以上であるため、浄化効率の高い排ガス浄化フィルタ 1 を得ることができる。

また、この場合には、仮に上記外周領域 2 5 に栓材 4 を設けないと、上記セラミックハニカム構造体 2 の強度が低く、欠けが生じやすい。そこで、上述のごとく外周領域 2 5 に栓材 4 を形成することにより、セラミックハニカム構造体 2 の強度を向上させ、ひいては排ガス浄化フィルタ 1 の強度を向上させることができる。

【0 0 4 5】

また、上記外周壁 2 1 は、0. 2 ~ 0. 8 mm の厚みを有するため、排ガス浄化フィルタ 1 の強度と排ガス浄化効率とを確保することができる。

また、上記セラミックハニカム構造体 2 は、コーージェライトからなるため、所望の気孔率の外周壁 2 1 及び隔壁 2 2 を有するセラミックハニカム構造体 2 を容易かつ安価に成形することができる。

【0 0 4 6】

以上のごとく、本例によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができる。

【0 0 4 7】

(実施例 2)

本例は、図 1 2、図 1 3 に示すごとく、実施例 1 とは異なる方法により、排ガス浄化フィルタ 1 を製造する例である。

即ち、実施例 1 において示したセラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1 (2 4 2) に対し、図 1 2 に示すごとく、仮想線 3 よりも内側の中央領域 2 6 にマスクテープ 5 を貼付する。

従って、マスクテープ 5 は、上記仮想線 3 に沿った外形を有する。

【0 0 4 8】

その後、栓詰め工程の前に、図 1 3 に示すごとく、上記仮想線 3 が通るセル 2 3 の開口部 2 3 1 を被うマスクテープ 5 に穴明けを施す穴明け工程を行う。この穴明け工程においては、上記仮想線 3 よりも内側の中央領域 2 6 におけるマスクテープ 5 にも、市松模様状に穴明けを施す。図 1 3 において、符号 5 5 が穴明けを施した穴明け部である。

その他は、実施例 1 と同様である。

【 0 0 4 9 】

本製造方法によれば、上記外周領域 2 5 にはマスクテープ 5 を貼付しないため、該マスクテープ 5 に穴明けを行うことなく、外周領域 2 5 に栓材 4 を形成することができる。そのため、穴明け工程における工数を削減することができ、排ガス浄化フィルタ 1 を容易に製造することができると共に、製造コストを削減することができる。

その他は、実施例 1 と同様である。

【 0 0 5 0 】

(実施例 3)

本例は、図 1 4 に示すごとく、仮想線 3 が通るセル 3 については栓材 4 を部分的に形成した排ガス浄化フィルタ 1 の例である。

即ち、まず、成形工程及びマスキング工程を、実施例 2 と同様に行う（図 1 2 参照）。次いで、穴明け工程の際、上記仮想線 3 が通るセル 2 3 については、穴明けを行わない。

その他は、実施例 2 と同様である。

【 0 0 5 1 】

これにより、図 1 4 に示すごとく、仮想線 3 が通るセル 3 については栓材 4 が部分栓となって形成される。この場合には、穴明け個所を更に少なくすることにより、穴明け工程における工数を削減することができる。

その他は、実施例 2 と同様の作用効果を有する。

【 0 0 5 2 】

(実施例 4)

本例は、マスキング工程において、セラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1 (2 4 2) 全体にマスクテープ 5 を貼付し、その後、仮想線 3 に沿って上記マスクテープ 5 を切断するカッティング工程を行う例である。

カッティング工程の後には、実施例 2 或いは実施例 3 と同様の方法により、排ガス浄化フィルタ 1 を製造する。

上記マスクテープ 5 の切断には、例えばレーザを用いる。

その他は、実施例 1 と同様である。

【 0 0 5 3 】

本製造方法によれば、上記セラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1, 2 4 2 にマスクテープ 5 を貼付する際、厳密な位置合せをする必要がないため、貼付作業が容易である。それ故、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを容易に製造することができる。

その他、実施例 1 と同様の作用効果を有する。

【 0 0 5 4 】

(実施例 5)

本例は、図 1 5 に示すごとく、マスキング工程においては、セラミックハニカム構造体 2 の端面 2 4 1 (2 4 2) 全体にマスクテープ 5 を貼付し、カッティング工程において、仮想線 3 が通るセル 2 3 の隔壁 2 2 に沿ってマスクテープ 5 を切断すると共に、その外側のマスクテープ 5 を除去する例である。

【 0 0 5 5 】

従って、切断ラインは、仮想線 3 の内側にある隔壁 2 2 に沿って描くことのできる最大面積を囲む閉曲線となる。

その後は、実施例 1 と同様の方法で、排ガス浄化フィルタ 1 を製造する。

上記マスクテープ 5 の切断には、例えばレーザを用いる。

その他は、実施例 1 と同様である。

【 0 0 5 6 】

本製造方法によれば、上記仮想線 3 が通るセル 2 3 を被うマスクテープ 5 をも除去して、該セル 2 3 の開口部 2 3 1 の全体を開放することができる。そのため、上記仮想線 3 が通るセル 2 3 には、その開口部 2 3 1 の全体に上記栓材 4 を形成することができる。

【 0 0 5 7 】

また、上記仮想線 3 が通るセル 2 3 の開口部 2 3 1 には、改めて穴明けを行う必要がない。

従って、本例によれば、強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタを容易に製造することができる。

その他、実施例 1 と同様の作用効果を有する。

【0058】

(実施例 6)

本例は、図 1 6，図 1 7 に示すごとく、本発明にかかる排ガス浄化フィルタの欠け発生度合を試験した例である。

本発明の排ガス浄化フィルタ、即ち、外周領域に栓材を形成した排ガス浄化フィルタを試料 1 とした。

また、試料 1 に用いたものと同様のセラミックハニカム構造体であって、外周領域に栓材を形成していないものを試料 2 とした。

また、比較的気孔率の低いモノリス 3 m i l 品を試料 3 とした。

各試料の各種データは、表 1 に示すとおりである。

【0059】

【表 1】

(表 1)

	試料 1	試料 2	試料 3
外周領域の栓材	有	無	無
寸法(直径×高さ)	129×50mm	129×50mm	129×50mm
外周壁の厚み	0.6mm	0.6mm	0.6mm
隔壁の厚み	0.3mm	0.3mm	0.09mm
セル数	300メッシュ	300メッシュ	600メッシュ
材質	コーージェライト	コーージェライト	コーージェライト
気孔率	65%	65%	35%

【0060】

試験方法としては、図 1 6 に示すごとく、各セラミックハニカム構造体 6 1 を、セルの貫通方向 T が鉛直方向 S に対して 4 5° となるように傾斜させた状態で、支持台 6 2 の上に載置する。

そして、底面の直径 2 0 m m，高さ 3 0 m m，質量 1 0 0 g の円柱状の鉛の錘 6 3 を、上記セラミックハニカム構造体 6 1 の角部 6 1 1 へ、上方 3 0 c m の位置から自由落下させる。

なお、錘 6 3 は、鉛直方向に配された円筒状のガイド 6 4 の中を落下させる。

【0061】

これにより、各セラミックハニカム構造体 6 1 の角部 6 1 1 に生じた欠けの深さを測定した。また、この試験を各試料につき、各 5 回行った。

試験の結果を図 1 7 に示す。同図に示す値は、5 回の試験結果の平均値である。

【0062】

図 1 7 から分かるように、本発明に係る試料 1 は、外周領域に栓材を設けなかった試料 2 よりも、欠けの深さが大幅に小さい。

そして、試料 1 は、気孔率が 6 5 % と大きいにもかかわらず、気孔率が 3 5 % と小さいモノリスからなる試料 3 と略同等の欠け深さであった。

以上の結果から、本発明によれば、欠けの発生を十分に防止することができる強度に優れた排ガス浄化フィルタを得ることができることが分かる。

【0063】

(実施例 7)

本例は、図 1 8 に示すごとく、栓材によって閉塞した外周領域の幅と、その排ガス浄化フィルタの圧損上昇率及び欠けの深さとの関係性を評価した例である。

即ち、サンプルとしては、上記外周領域の幅をそれぞれ、セル 1 ピッチ分、2 ピッチ分、3 ピッチ分、4 ピッチ分としたのものと、外周領域に栓詰めしないものを用意した。

【0 0 6 4】

上記圧損上昇率とは、外周領域に栓詰めをしないものを基準にした圧力損失の上昇率である。該圧力損失は、排ガス浄化フィルタに $5 \text{ m}^3/\text{分}$ で室温空気を流したとき、上記排ガス浄化フィルタの両端面における圧力差として求めた値である。後述する実施例 8 における圧力損失も同様に求めた値である。

また、欠けの深さは、上記実施例 6 に示した欠け試験方法により測定したものである。

図 1 8 において、上記圧損上昇率を○にて表し、上記欠けの深さを●にて表す。

【0 0 6 5】

図 1 8 から分かるように、圧損上昇率は、上記外周領域が 2 ピッチ分を超えると大きくなる。また、該外周領域が 4 ピッチ分となると、圧損上昇率が更に大きくなり、40%を超える。

また、欠けについては、栓詰めなしのものに比べると外周領域 1 ピッチ分に栓詰めすることにより、欠け深さを小さくすることができる。更に、外周領域 2 ピッチ分とすることにより、欠け深さを更に小さくすることができる。

上記の結果から、上記外周領域の幅としては 1 ～ 3 ピッチ分とする必要があり、好ましくは、1 ～ 2 ピッチ分とするのがよいことが分かる。

【0 0 6 6】

(実施例 8)

本例は、図 1 9 に示すごとく、セラミックハニカム構造体の隔壁の厚みと、排ガス中のパティキュレートの捕集率及び圧力損失との関係性を評価した例である。

上記捕集率は、以下の手段によって測定した値である。

即ち、上記各排ガス浄化フィルタに対し、パティキュレートを含む排ガスを、 $2 \text{ m}^3/\text{分}$ の流量で流入させた。そして、排ガスを流入させる前後における排ガス浄化フィルタの質量 $M1$ 、 $M2$ をそれぞれ測定すると共に、排ガス浄化フィルタを通過したパティキュレートの質量 N を計測した。そして、上記質量 $M1$ 、 $M2$ 、及び N を基にして、計算式

$$P = (M2 - M1) / (M2 - M1 + N)$$

により計算することにより、パティキュレートの捕集率 P を算出した。

【0 0 6 7】

図 1 9 において、上記捕集率を●にて表し、上記圧力損失を○にて表す。

図 1 9 に示すごとく、上記捕集率については、隔壁の厚みを 0.25 mm 以上とすることにより、十分に高くすることができる。ただし、隔壁の厚みが 0.40 mm を超えると、圧力損失が極端に大きくなる。

上記の結果から、上記隔壁の厚みとしては、0.25 ～ 0.40 mm とすることが好ましいことが分かる。

【図面の簡単な説明】

【0 0 6 8】

【図 1】 実施例 1 における、排ガス浄化フィルタの正面図。

【図 2】 実施例 1 における、排ガス浄化フィルタの斜視図。

【図 3】 実施例 1 における、セルの貫通方向に沿った排ガス浄化フィルタの断面図。

【図 4】 実施例 1 における、セルの開口部の正面図。

【図 5】 実施例 1 における、セラミックハニカム構造体にマスクテープを貼付した状態を表す斜視説明図。

【図 6】 実施例 1 における、穴明けすべきマスクテープの位置を検出する様子を表す斜視説明図。

【図 7】 実施例 1 における、セラミックハニカム構造体に貼着したマスクテープに穴

明けを行う様子を表す斜視説明図。

【図 8】実施例 1 における、セラミックハニカム構造体の端面を栓材スラリーにディッピングする状態を表す断面説明図。

【図 9】実施例 1 における、ディッピング後の状態を表す断面説明図。

【図 1 0】実施例 1 における、セラミックハニカム構造体の他の端面を栓材スラリーにディッピングする状態を表す断面説明図。

【図 1 1】実施例 1 における、セラミックハニカム構造体の両端面をディッピングした後の状態を表す断面説明図。

【図 1 2】実施例 2 における、端面にマスクテープを貼付したセラミックハニカム構造体の正面図。

【図 1 3】実施例 2 における、マスクテープに穴明けを施した状態を表す説明図。

【図 1 4】実施例 3 における、排ガス浄化フィルタの正面図。

【図 1 5】実施例 5 における、セラミックハニカム構造体の端面に貼着したマスクテープを切断した状態を表す説明図。

【図 1 6】実施例 6 における、欠け試験方法の説明図。

【図 1 7】実施例 6 における、試験結果を表す線図。

【図 1 8】実施例 7 における、測定結果を表す線図。

【図 1 9】実施例 8 における、測定結果を表す線図。

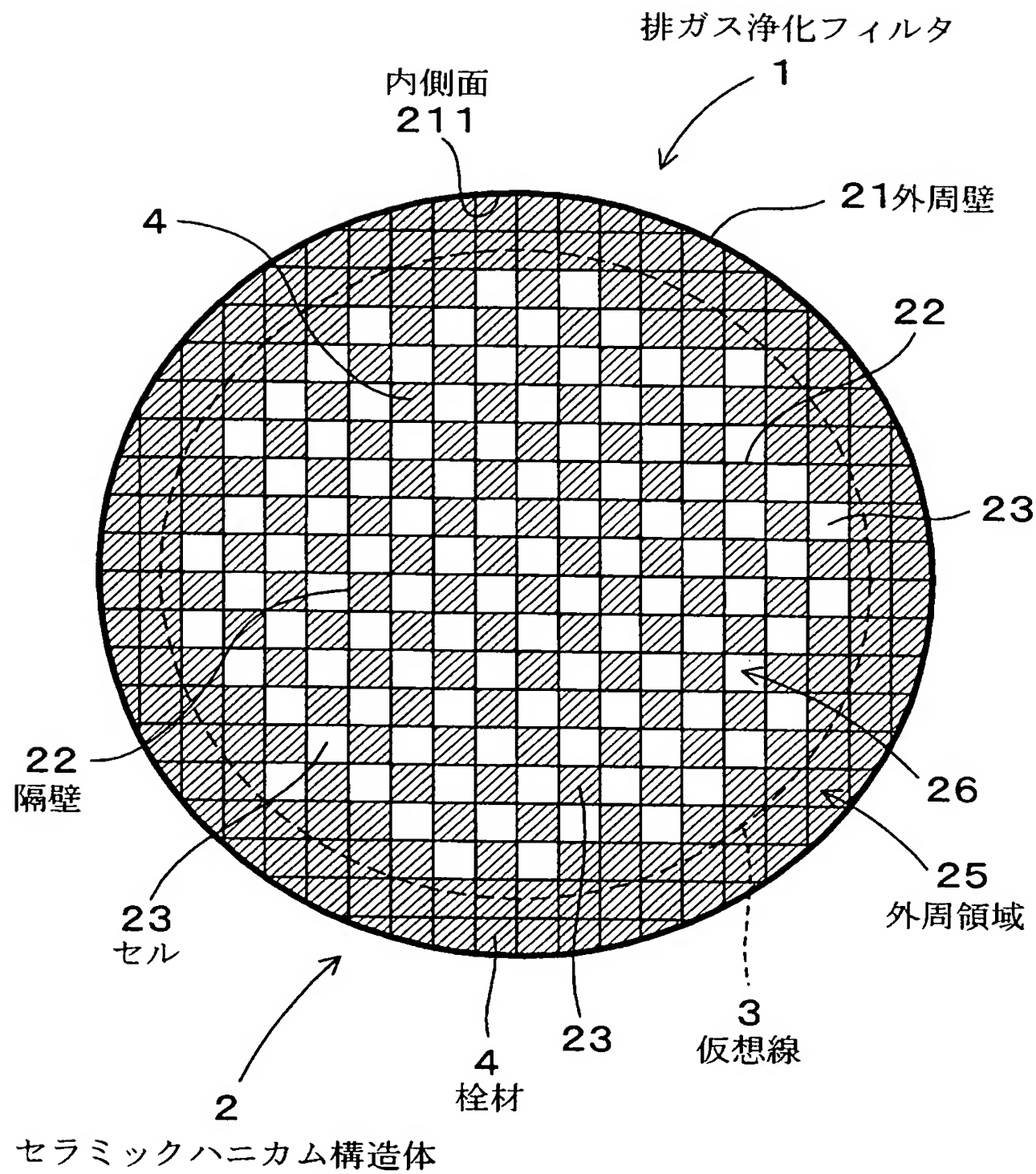
【符号の説明】

【0 0 6 9】

- 1 排ガス浄化フィルタ
- 2 セラミックハニカム構造体
 - 2 1 外周壁
 - 2 1 1 内側面
 - 2 2 隔壁
 - 2 3 セル
 - 2 4 1, 2 4 2 端面
 - 2 5 外周領域
- 3 仮想線
- 4 栓材

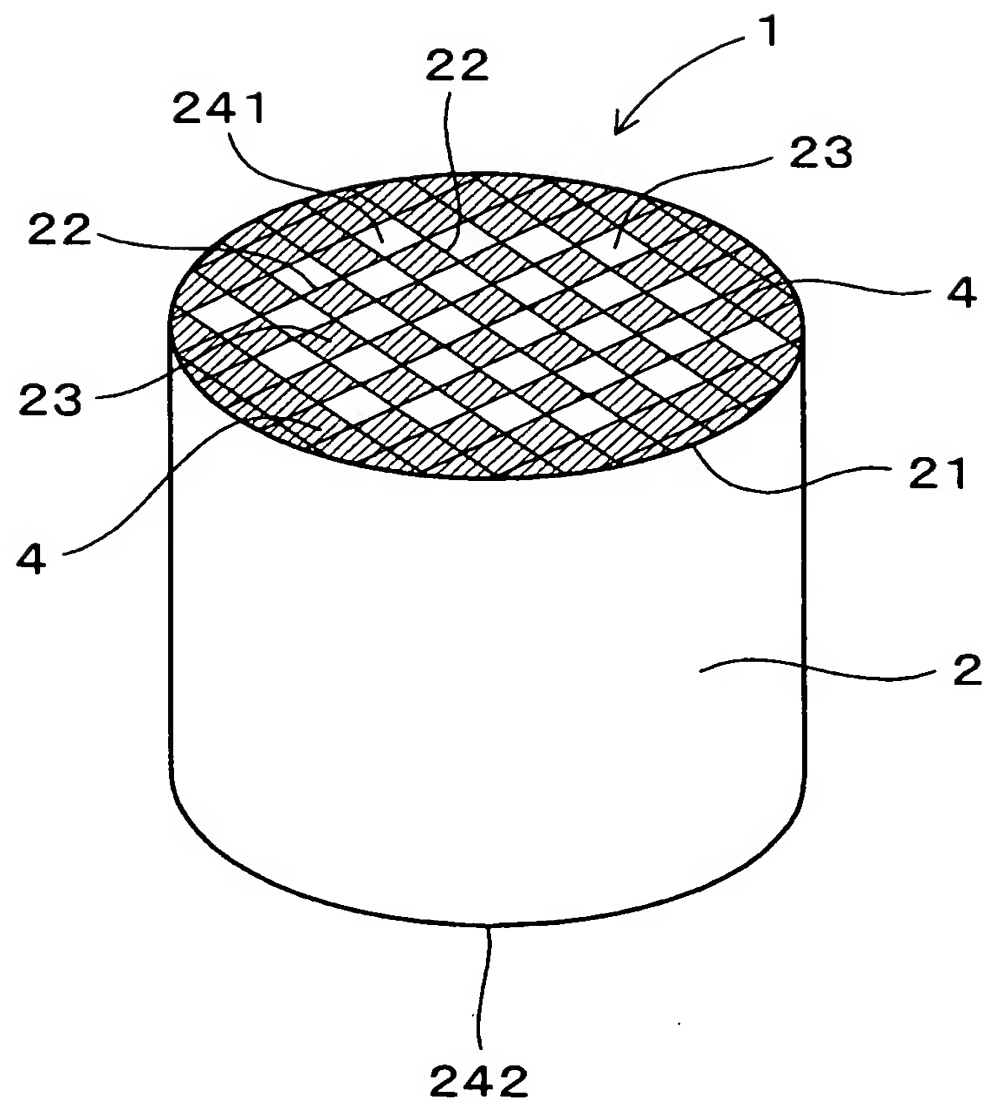
【書類名】 図面
【図 1】

(図 1)



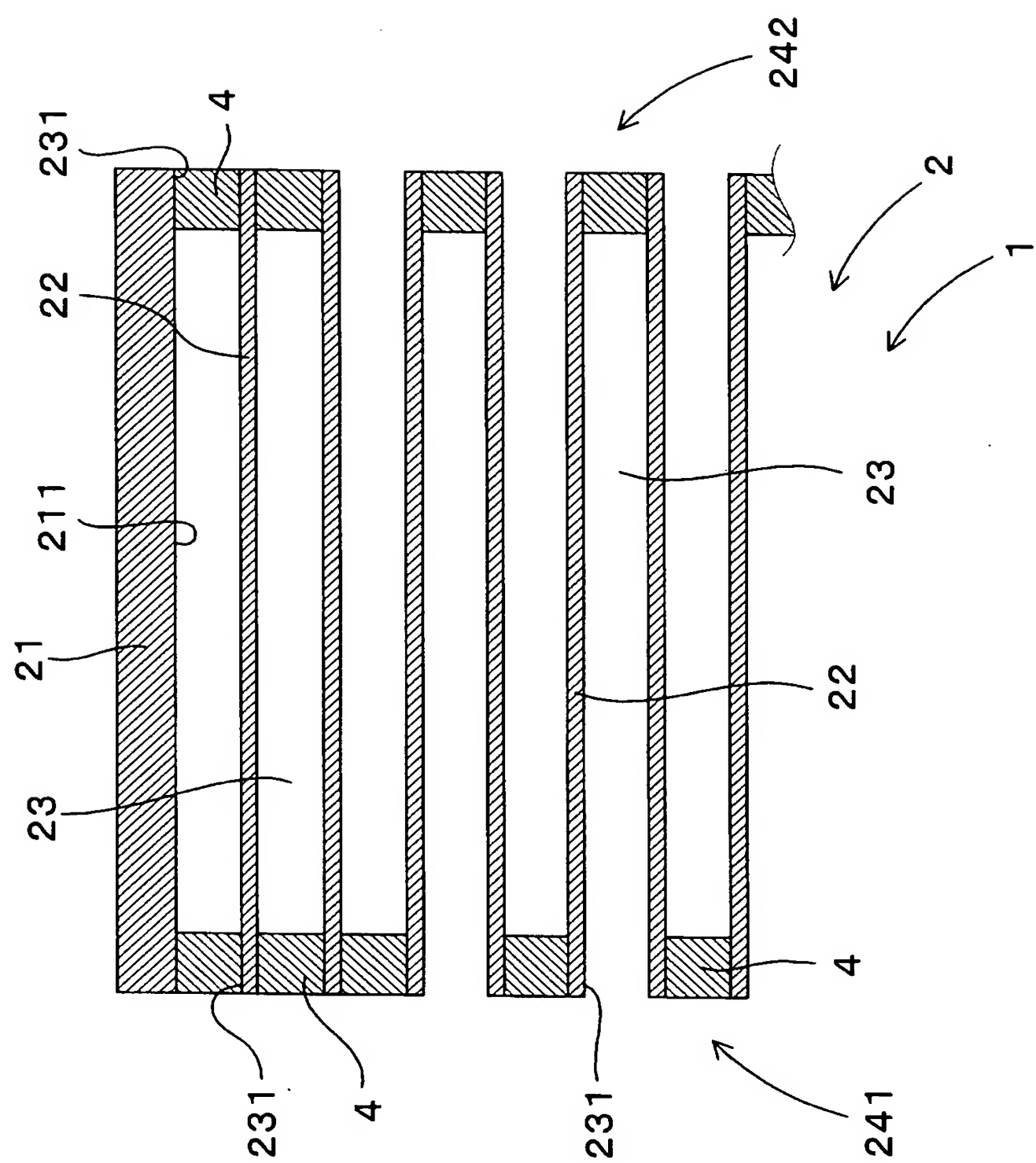
【図 2】

(図 2)



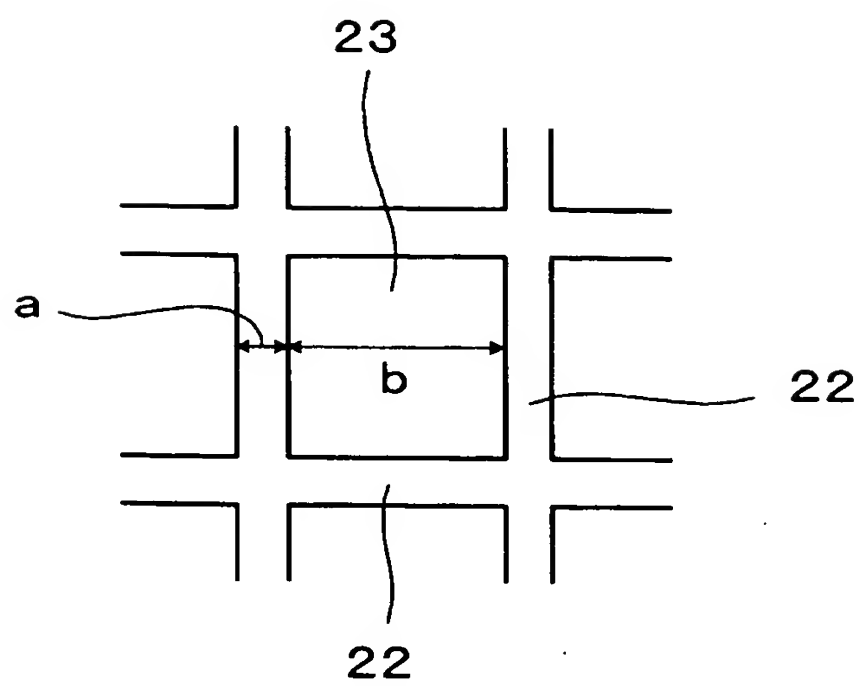
【図 3】

(図 3)



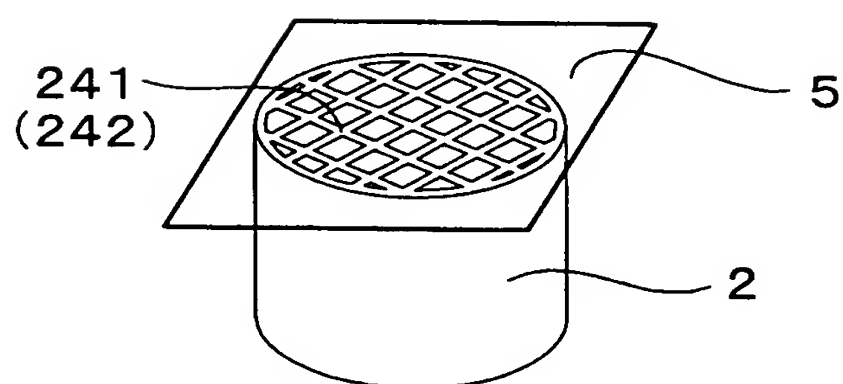
【図 4】

(図 4)



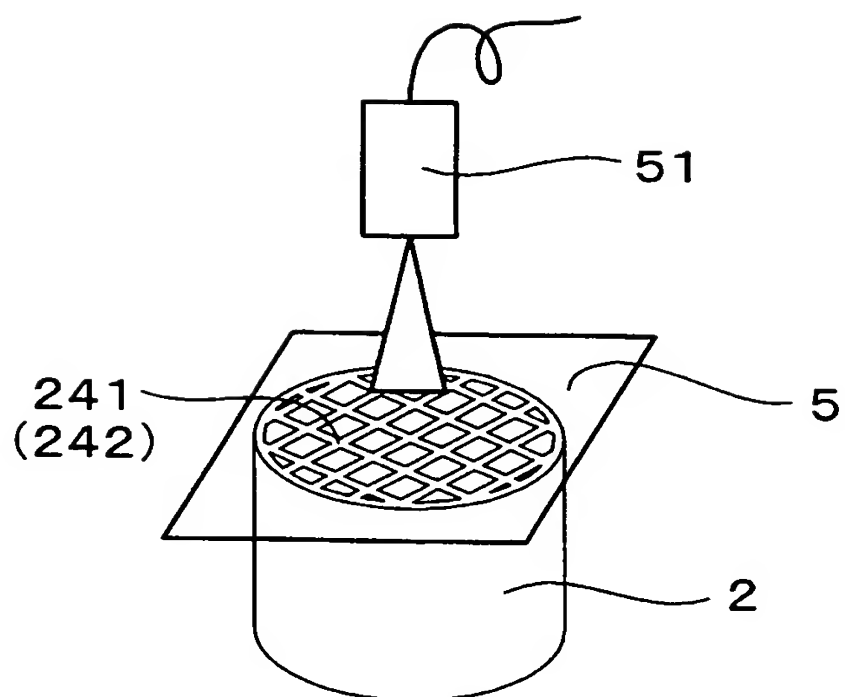
【図 5】

(図 5)



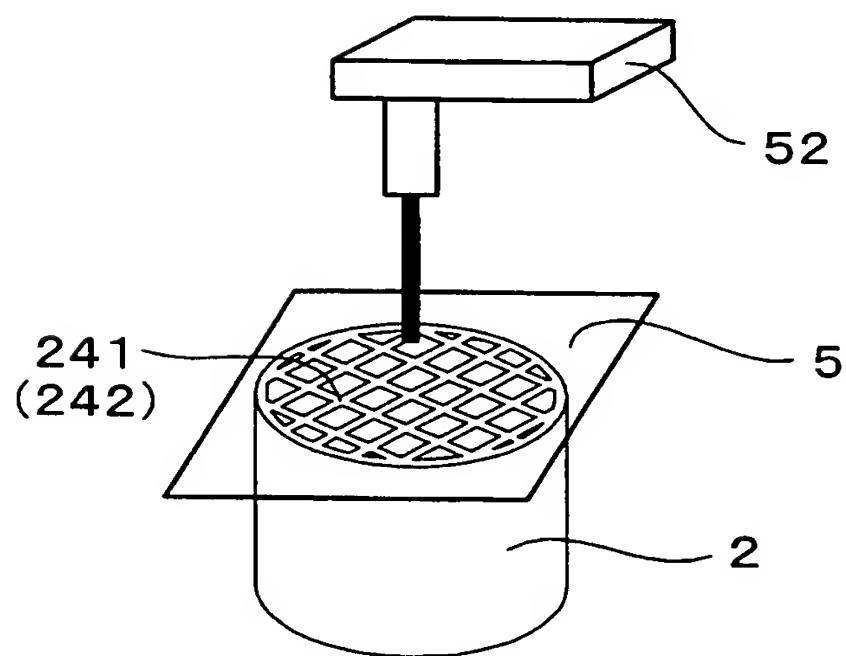
【図 6】

(図 6)



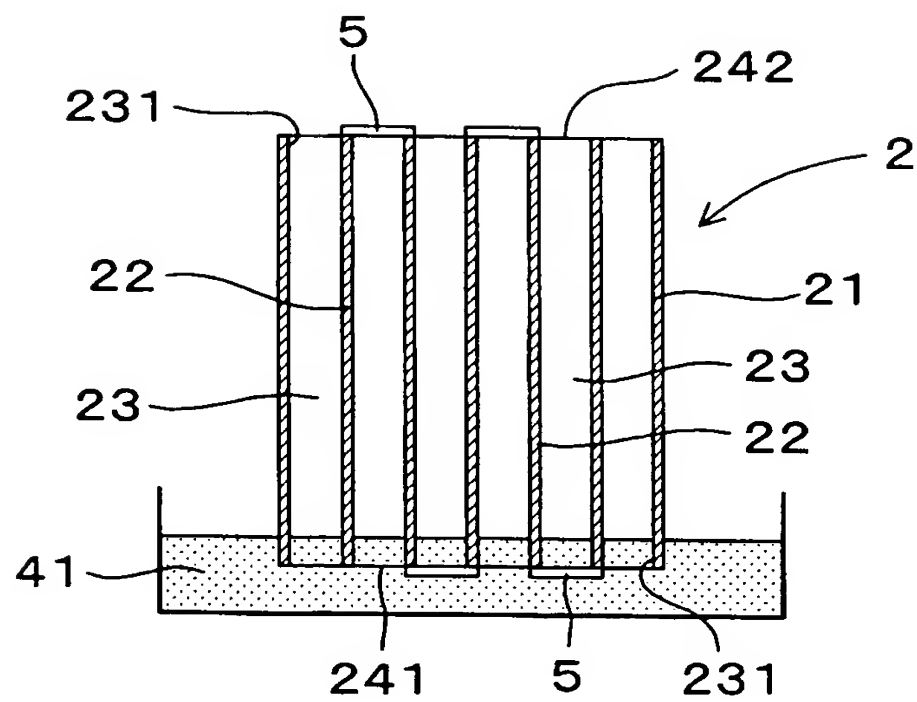
【図 7】

(図 7)



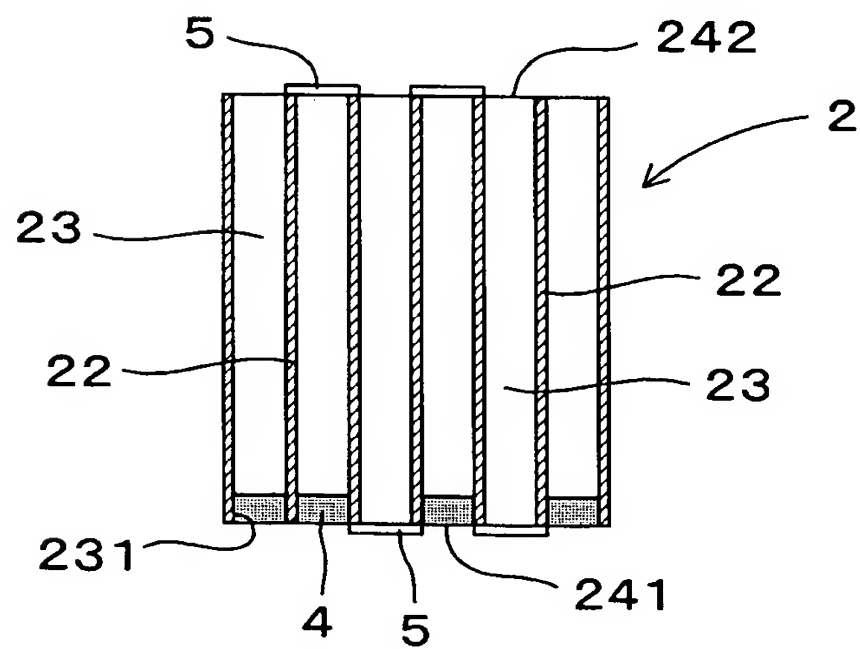
【圖 8】

(图 8)



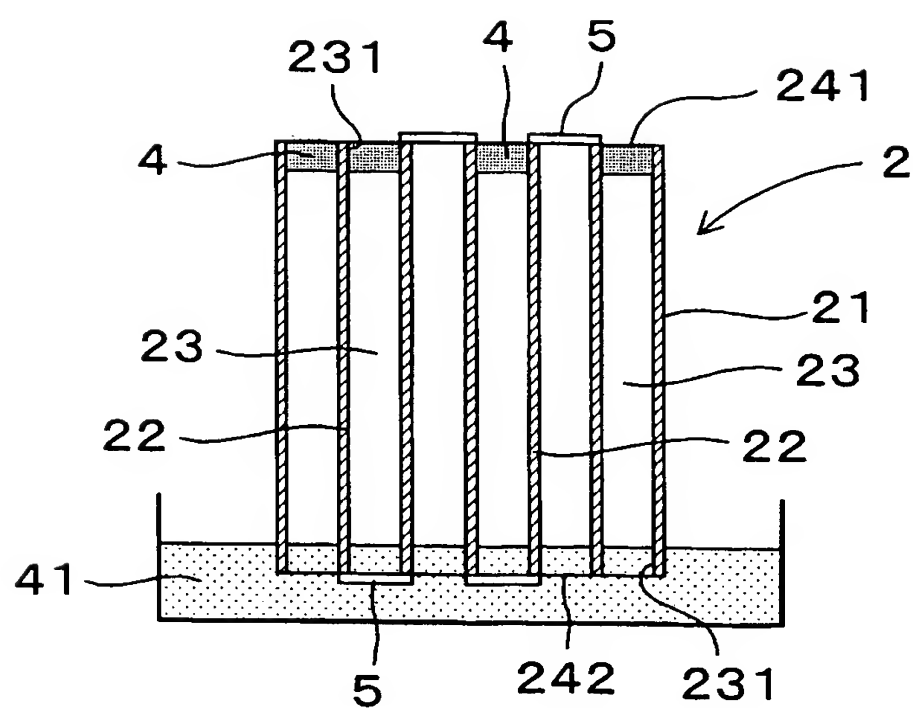
【图 9】

(图 9)



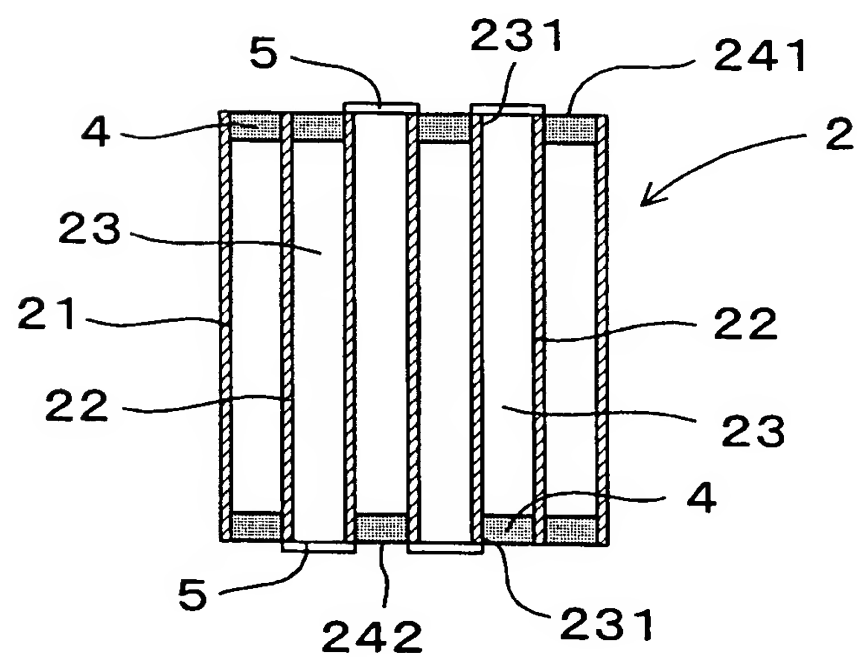
【図 10】

(図 10)



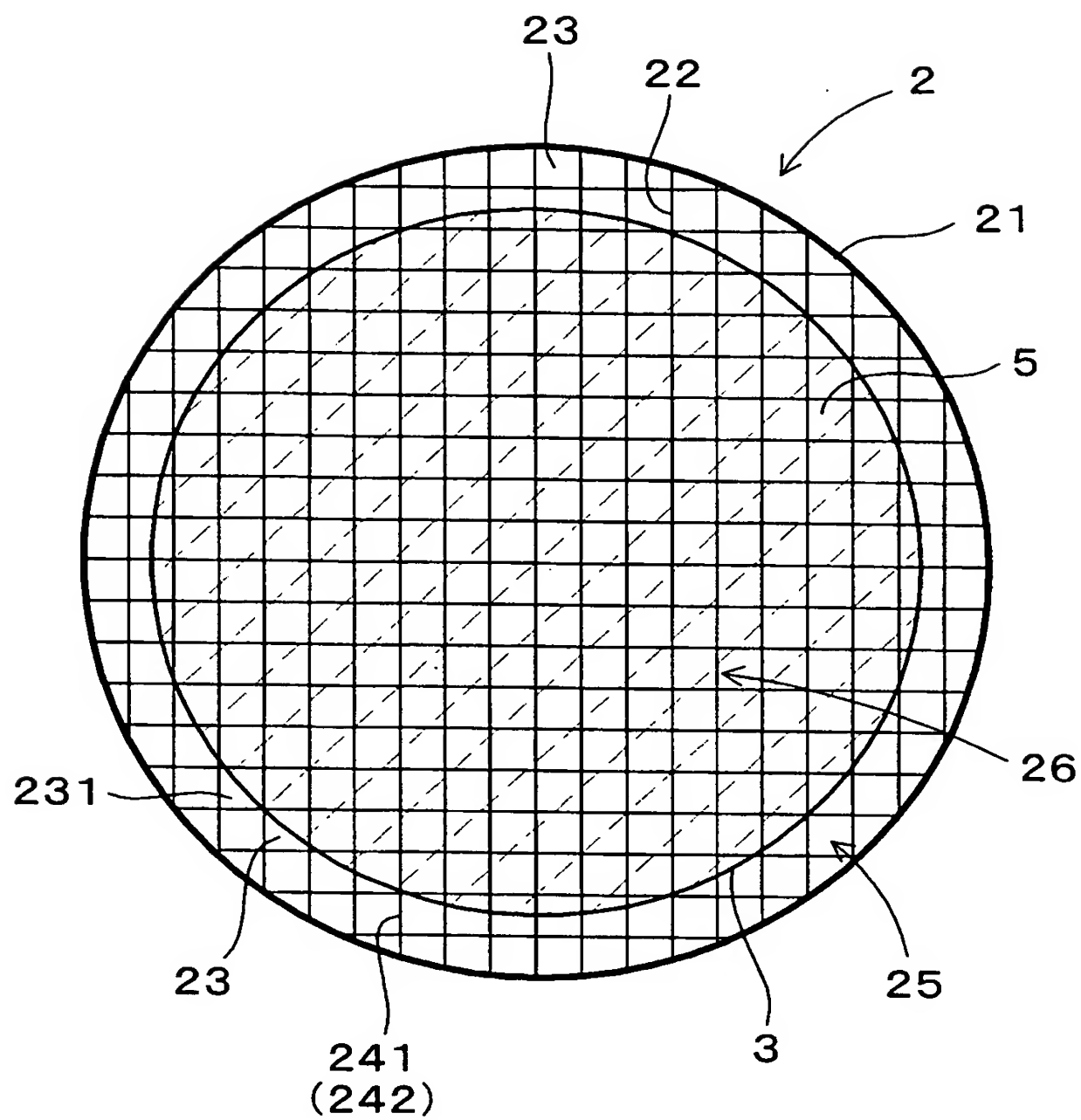
【図 11】

(図 11)



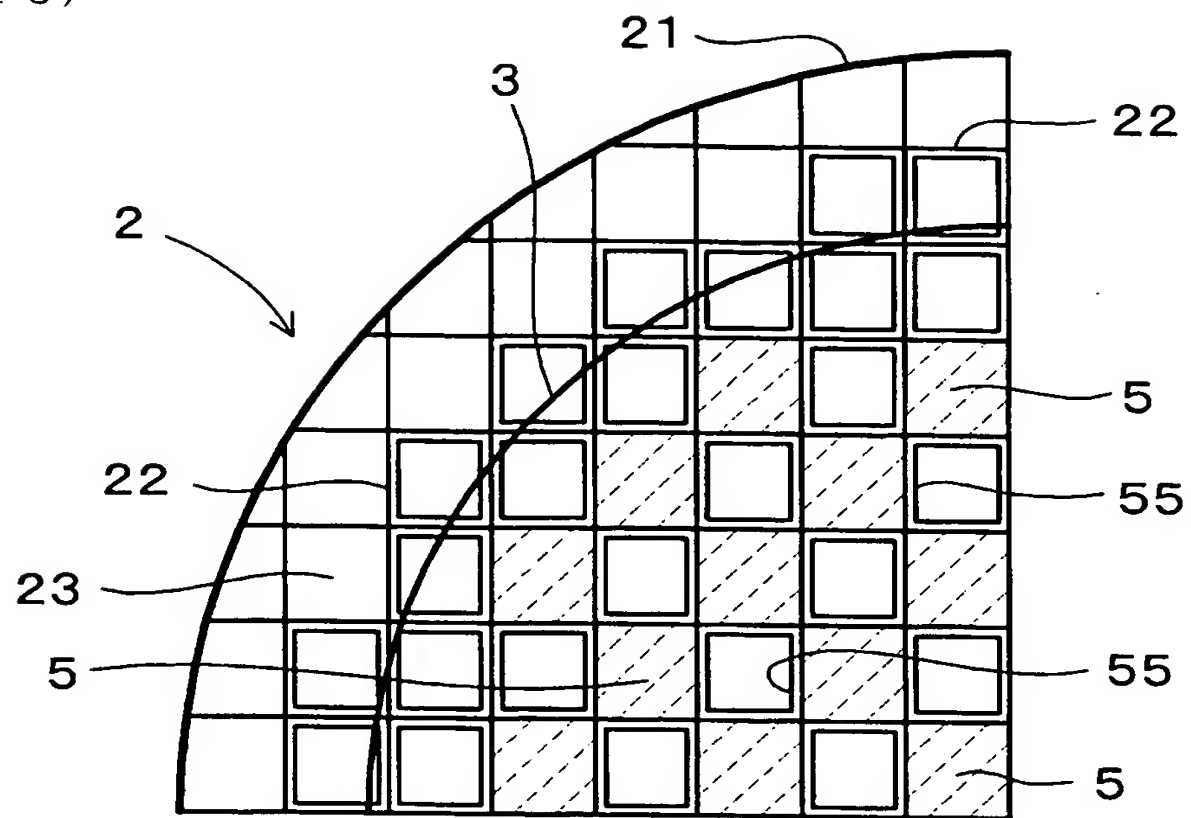
【図 12】

(図 12)



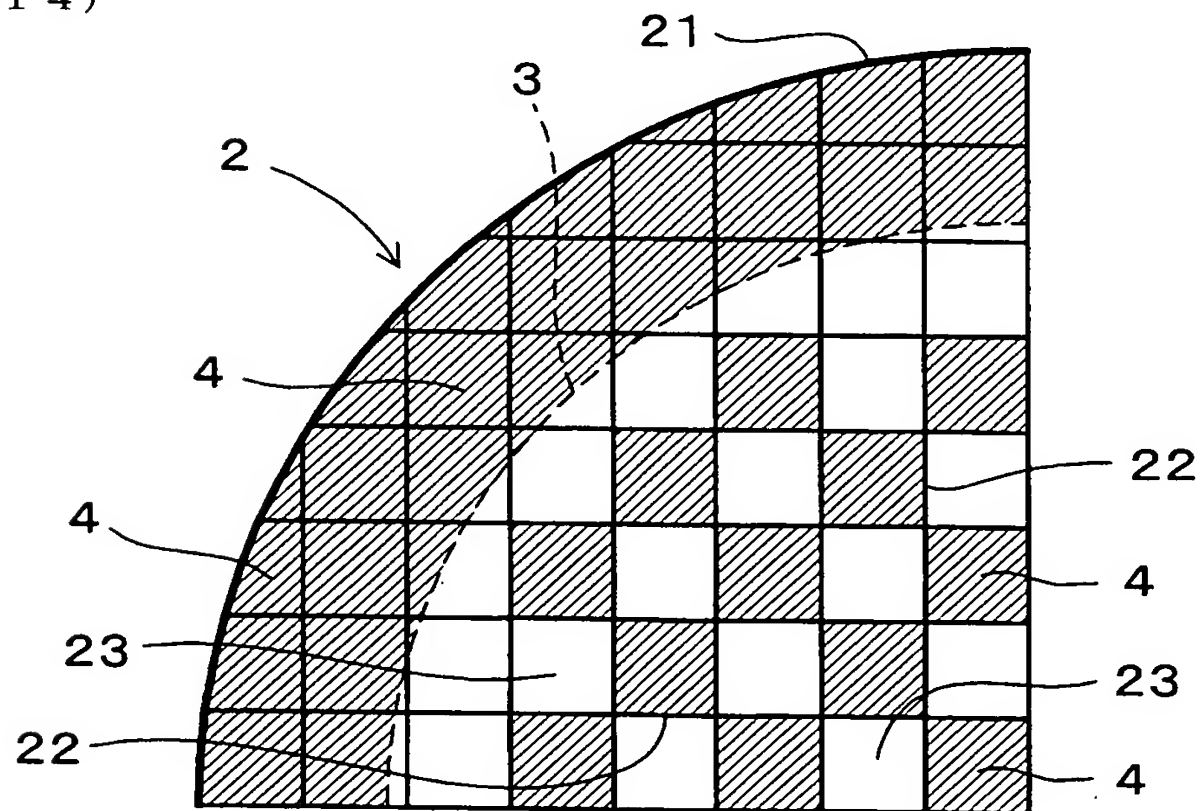
【図 13】

(図 13)



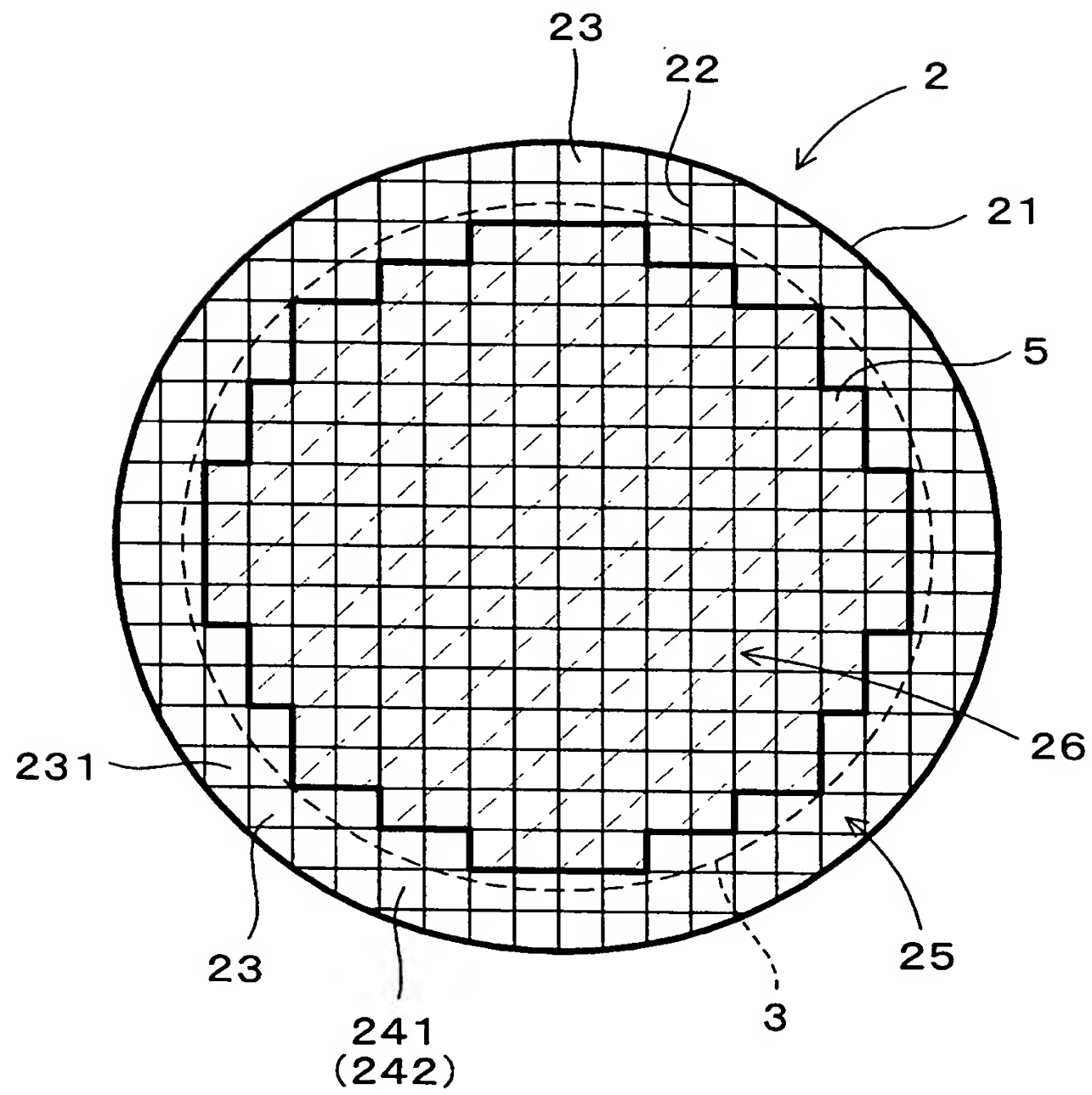
【図 14】

(図 14)



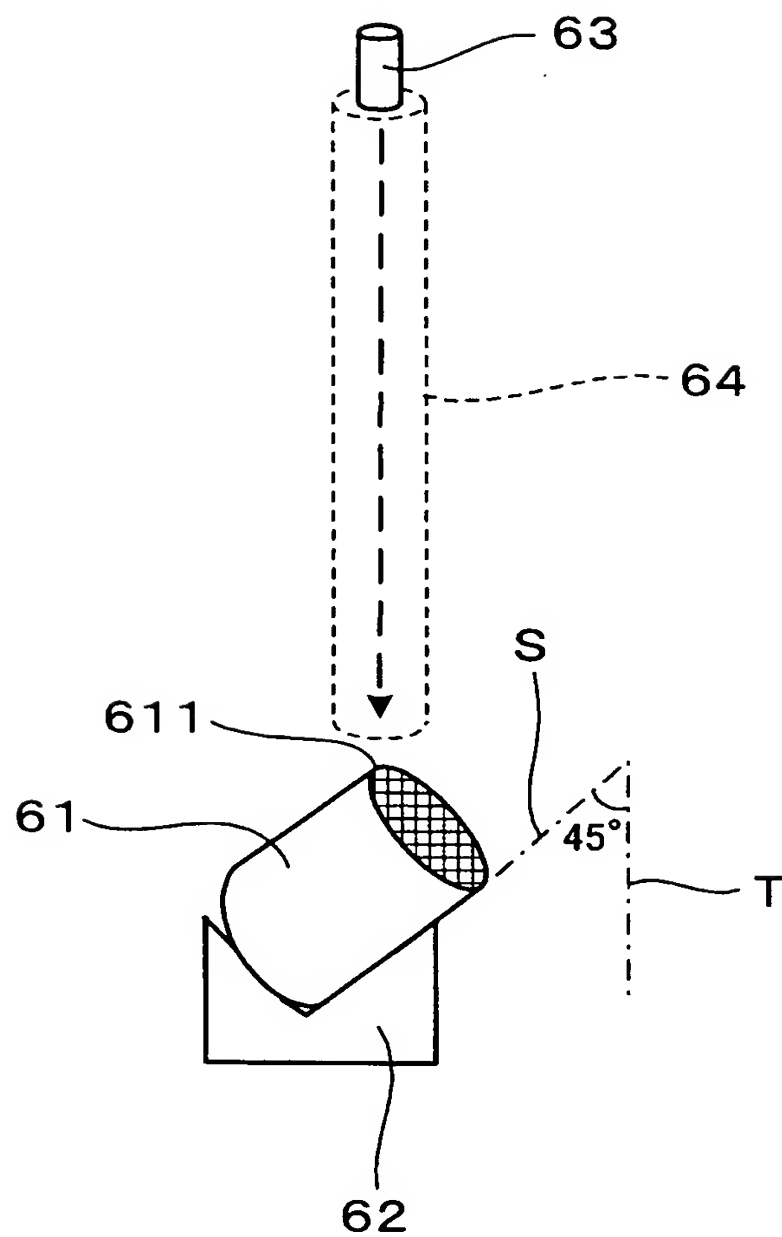
【図 1 5】

(図 1 5)



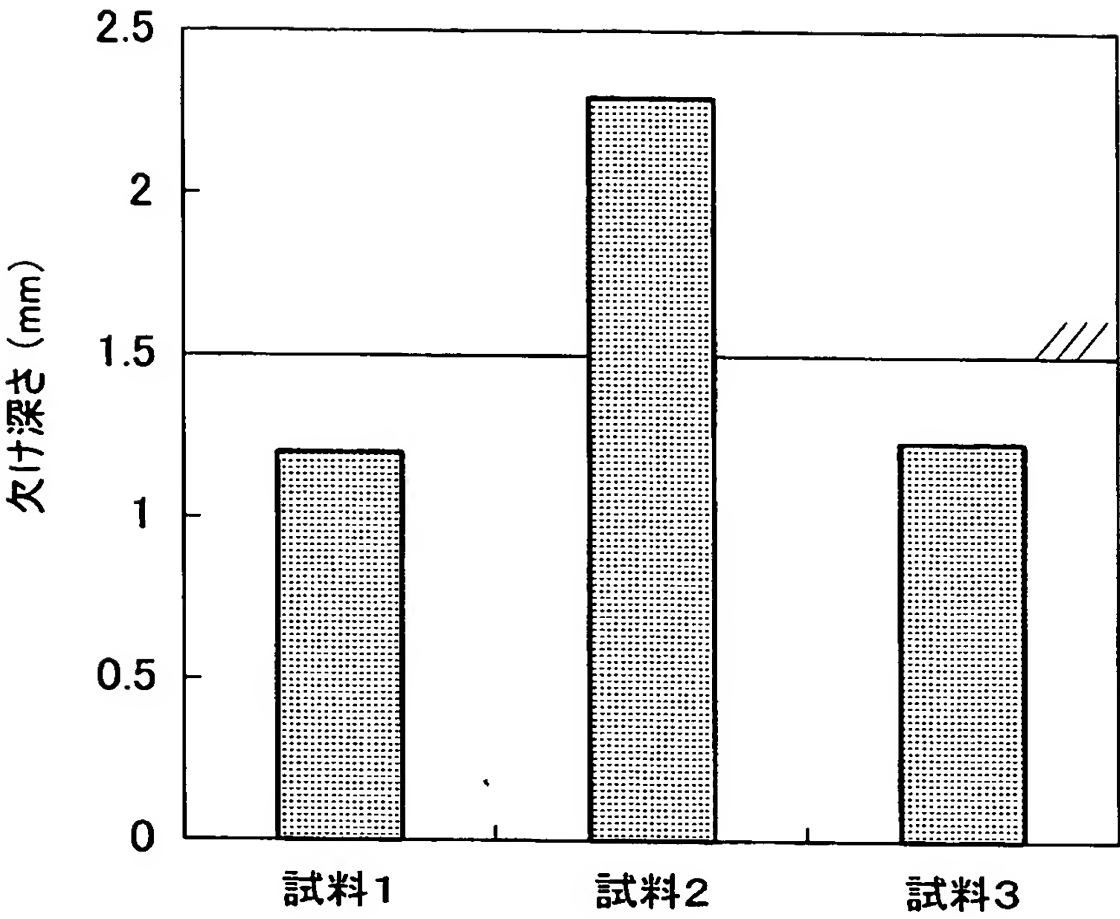
【図 16】

(図 16)



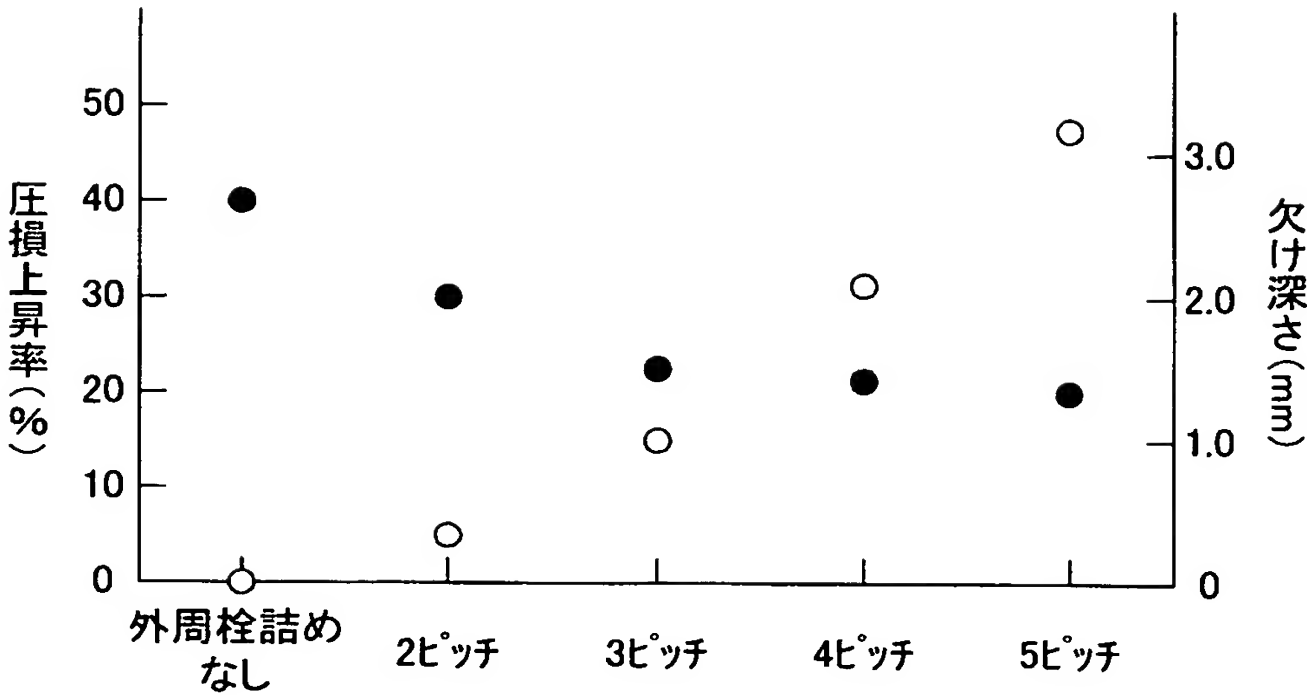
【図 1 7】

(図 1 7)



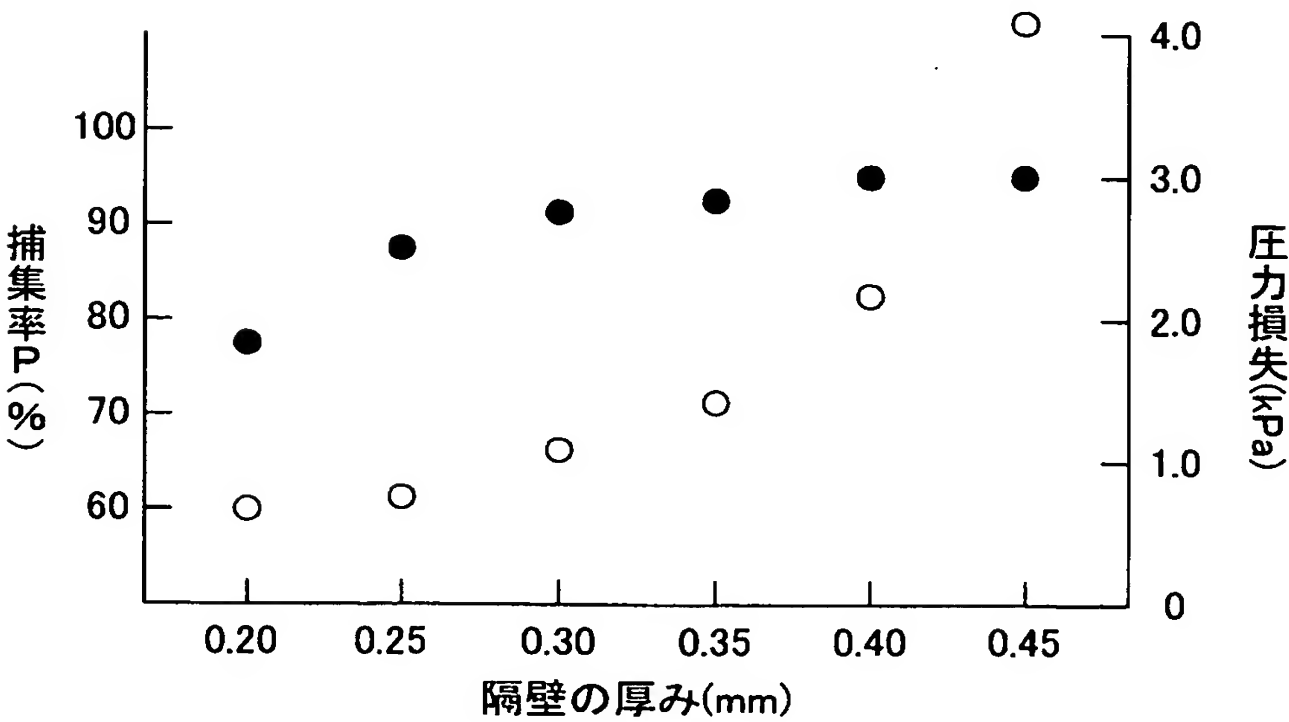
【図 1 8】

(図 1 8)



【図 1 9】

(図 1 9)



【書類名】要約書

【要約】

【課題】強度が高く、かつ排ガスの浄化効率に優れた排ガス浄化フィルタ及びその製造方法を提供すること。

【解決手段】外周壁 2 1 と、外周壁 2 1 の内側においてハニカム状に設けられた隔壁 2 2 と、隔壁 2 2 により仕切られていると共に両端面 2 4 1, 2 4 2 に貫通してなる複数のセル 2 3 とを備えたセラミックハニカム構造体 2 を有する排ガス浄化フィルタ 1。セラミックハニカム構造体 2 の両端面 2 4 1, 2 4 2 は、外周壁 2 1 の内側面 2 1 1 からセル 1 ピッチの 1. 0 ～ 3. 0 倍の長さ分内側に入った部分を連続的に繋げた仮想線 3 を設けたとき、仮想線 3 よりも外側の外周領域 2 5 を 9 0 % 以上栓材 4 によって閉塞してなる。

【選択図】図 1

特願 2 0 0 3 - 3 1 5 8 3 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 6 0]

1. 変更年月日	1 9 9 6 年 1 0 月 8 日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地
氏 名	株式会社デンソー